

発注のご案内

モデル	内容
FKP-STD(M-FKP-STD)	ファイバ光学実験教育キット(プロジェクト1-10) : Inc.1918-Rと918D (2コ)付属
FKP-STD-NN (M-FKP-STD-NN)	ファイバ光学完全教育キット(プロジェクト1-10)
FKP-INT (M-FKP-INT)	ファイバ光学教育キット(プロジェクト1と3) : 1918-Rと918D 付属.
FKP-INT-NN (M-FKP-INT-NN)	ファイバ光学教育キット(プロジェクト1と3)
FKP-COM (M-FKP-COM)	ファイバ光学教育キット(プロジェクト5、8、および7の一部)1918-Rと918D 付属
FKP-COM-NN (M-FKP-COM-NN)	ファイバ光学教育キット(プロジェクト5、8、および7の一部)

キットアクセサリ発注のご案内

モデル	内容
F-BK3	マニュアルファイバクリバ、0.5°、コーティング250-900 μm、クラッド125 μm、クリア径6-10 mm
SG-22-2 (M-SG-22-2)	SG ブレッドボード、2フィートx2フィートx2.4 in.、1/4-20ホール

コンポーネントのリストは弊社までお問合せ下さい。

干渉実験キット Projects in Interferometry



- 8つのプロジェクトからなり、20種類以上の体験実習が可能
- 干渉計を使用するアプリケーションで必要となる機材をすべて含む
- アプリケーションを段階的に分けた詳細なワークブックが付属しますから、どの部品をどのプロジェクトで使用するかがすぐに判明
- モジュール化され、アップグレード可能な設計 : Newportのコンポーネントに適合しますから経済的かつ効率的にアップグレード可能
- 高品位50.8 mm径光学部品を使用—大口径ビームが測定と干渉縞の解釈を容易化

干渉実験キット(Projects in Interferometry)は、学生は勿論、研究者やエンジニアが光干渉とその代表的アプリケーションを学習する最適なキットです。必要な機材がひとつのパッケージにまとめられている「干渉実験キット」は光学実験の新規セットアップや干渉実験機能の追加にも適しています。あれこれ迷うことなく経済的にラボの機能を拡張できます。

波長測定や波長ひずみ、白色光干渉、屈折率などは複数のセットアップが可能のように設計されています。複数の干渉方法を試みることにより、広い範囲の実験テクニックが身に付きます。キットに含まれる高面精度M/10のオプティクスと精密コンポーネントを使用して精度の高い測定値が得られます。大きな、2インチのビーム径を使用しますから、測定と結果の解明が簡単です。インチまたはミリ仕様のコンポーネントは簡単かつ経済的にアップグレードが可能です。キットの精密コンポーネントは、広い範囲のNewport製光学部品やアクセサリと互換性がありますから、いつでも簡単に機能を拡張してさらに高度な研究や教育に活用することができます。

それぞれのキットは必要な機材をすべて含み、さらに基本概念から始めて豊富な内容を解説したワークブックが付属します。それぞれの実験セクションは以下の内容を含みます : 実験セットアップの概要、デモンストレーション方法、予想される結果、および関連する光学原理の詳細な説明。それぞれのプロジェクトは自己完結していますから、どの実験からスタートしてもかまいません。

干渉現象の教育コースにはフルセットの使用をお奨めします。また、プログラムのニーズに合わせて適当なプロジェクトを選択して頂くことも可能です。

プロジェクト

プロジェクト 名称	特徴
1 シャーリング干渉計	照準試験と波面曲率半径の測定
2 光学部品の試験	光学性能指数、光学部品の歪曲と波面品質の測定
3 屈折率測定	トワイマン-グリーン干渉計を用いたBK7ガラスプリズムの屈折率測定
4 干渉法による熱勾配測定	マイケルソン干渉計を用いた温度に対する傾斜屈折率と長さの測定
5 透過物質の厚さ測定	マッハツェンダ干渉計を用いた透過材料の厚さ測定
6 波長計	633 nmと543 nmのHe-Neレーザーを用いた未知レーザーの波長測定
7 変位センサ	マイケルソン干渉計を用いた精密距離測定
8 白色光干渉計	広帯域水銀ランプを用いたマイケルソン干渉計の組み立て、そのスペクトル線幅を測定

M-OEK-100キットの内容

個数	モデル	仕様
1	40 (M-40)	標準ロッド、14 in.、1/4-20スレッド
1	861	CMA-CCアクチュエータ用のハンドヘルドコントローラ
2	ULM-TILT	レーザマウント
1	10BR08	精密直角プリズム、BK7、A=B=C=25.4、 $\lambda/4$ 、コーティング無し
1	10D20ER.1	広帯域金属ミラー、パイレックス、25.4 mm直径、 $\lambda/10$ 、450-750 nm
1	14768-01	ボールドライブセット
1	19746-01	水銀ランプ(プロジェクト8)、OEK-100
1	19747-01	電源(プロジェクト8)、OEK-100
1	19748-01	ランプマウント(プロジェクト8)、OEK-100
2	19749-01	UVフィルタ(プロジェクト8)、OEK-100
2	20B20BS.1	広帯域誘導ビームスプリッタBK7、直径50.8 mm $\lambda/10$ 、480-700 nm
1	20D20ER.1	広帯域金属ミラー、パイレックス、直径50.8 mm、 $\lambda/10$ 、450-700 nm
1	20QS20	シアプレート コリメーションテスト、直径50.8 mm
1	340-RC (M-340-RC)	ロッドクランプ1.5 in. 直径モデル40、41及び45、1/4-20
1	462-X-M	ULTRAlign™ 精密クロスローラーベアリング直進ステージ、移動量1.0 in. X
1	481-A (M-481-A)	回転ステージ、360°粗調マイクロメータ付(プロジェクト5)
1	818-BB-21	バイアスフォトディテクタ、300-1100 nm、シリコン、1.2 GHz
1	CMA-25CC	移動量25 mm CMAアクチュエータ、オープンループDCサーボ、CMA(プロジェクト6)
2	AC-1A	アジャスト式レンズマウント、直径5.0-46.2 mm径、31.8 mm軸高
1	AC-2A	アジャスト式レンズマウント、17.8-57.1 mm径、31.8 mm軸高
4	B-2SA	ステンレス鋼製ベースプレート、移動レンジ1 in.
2	BC-5	高さアジャスト式ベースクランプ
1	COR-1	回転中心アダプタ(P100-Pプラットフォーム用)
1	RG-23-4 (M-RG-23-4)	光学 ブレッドボード、調査グレード、2ft x 3ft x 4.4 in.、1/4-20ホール
1	DM-13	差動マイクロメータ、粗調13.0 mms、微調0.2 mm、耐荷量5lb1
1	FC-1 (M-FC-1)	フィルタクランプ、0.50 in.(12.7 mm)ポスト
1	FK-18683	温度計 FKP-ADV
3	U200-A2K	2 in. 直径精密クリアエッジ、ミラーマウント、固定ノブアジャスト式
2	ID-0.5	アイリス絞り、1-11 mm開口、10リース
1	KBX055	BK7両凸レンズ、25.4 mm径、EFL=62.9 mm、コーティング無し

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシヤッタ

アクセサリ

ベース&ブラケット

ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット

フィルターマウント

実験キット
アプリケーション
キット

個数	モデル	仕様
1	KPX085ER.1	凸面ミラー、 $f=-62.90$ mm
1	KPX187	平凸レンズ、BX7直径50.88 mm、EFL=100 mm、コーティング無し
1	LC-V	コリメータモジュール OEK-100
1	M-40X	顕微鏡対物レンズ、倍率40、0.65NA、4.5 mm 焦点距離、50 mmクリア
2	MCF	小型レイルフラットキャリア、1/4-20(M6)CLR,MRLシリーズ
2	MH-2P	直径0.75 in.(19.1 mm)径固定レンズマウント
1	MH-2PM	固定顕微鏡用対物マウント、0.800-36RMSスレッド
1	P100-P (M-P100-P)	プラットフォーム光学マウント、直径1.0 in. 径、 ± 6 度ノブアジャスト式8-32スレッド
1	UPA1	直径25.4 mmプラットフォームマウント用ミラーアダプタ
1	V100-P2	VIZIX プラットフォーム光学マウント、2.0x2.0 in.、2ノブアクチュエーター
2	MPH-3 (M-MPH-3)	高さ3インチミニチュアポストホルダ、直径ポスト0.313、1/4-20スレッド
1	MRL-18M (M-MRL-18M)	小型光学レール、長さ18 in.、幅0.75 in.、8-32スレッドと1/4-20CLR
1	MRL-3 (M-MRL-3)	小型光学レール、長さ3 in.、幅0.75 in.、8-32スレッドと1/4-20CLR
1	MRL-6M (M-MRL-6M)	小型光学レール、長さ6 in.、幅0.75 in.、8-32スレッドと1/4-20CLR
2	MSP-3 (M-MSP-3)	小型光学ポスト直径0.313径 x 8-32 ねじ穴
1	PT-1	プリズムテーブル、干渉計キットプロジェクト
1	SK-08A (M-SK-M4A)	ブラックオキシッド仕上げのスクリューキット、8-32、品揃え量、249
1	SK-25A (M-SK-M6A)	ブラックオキシッド仕上げのスクリューキット、1/4-20、品揃え量、261
1	SM-25	パーニアマイクロメータ、移動量25 mm、耐荷重23 lb、50.8 TPI
2	SP-2 (M-SP-2)	直径0.5 x 2 in.標準ポスト、8-32と1/4-20ねじ穴
8	SP-3 (M-SP-3)	直径0.5 x 3 in.標準ポスト、8-32と1/4-20ねじ穴
1	SP-4 (M-SP-4)	直径0.5 x 4 in.標準ポスト、8-32と1/4-20ねじ穴
1	R-30025	1.5 mW、He-Neレーザー偏光(500:1)633 mm
1	R-30968	グリーンHe-Neレーザー、0.5 mW、543nm(プロジェクト6)
2	VPH-2 (M-VPH-2)	2 in.高、直径0.5標準ポストホルダ、1/4-20スレッド
8	VPH-3 (M-VPH-3)	3 in.高、直径0.5標準ポストホルダ、1/4-20スレッド
1	VPH-4 (M-VPH-4)	4 in.高、直径0.5標準ポストホルダ、1/4-20スレッド
1	19979-01	石英キュベット
1	OEK-111	プロジェクトワークブック

発注のご案内

モデル	仕様
OEK-100	干渉計教育キット、115V仕様
M-OEK-103	干渉計教育キット、220V仕様
OEK-111	プロジェクトワークブック



ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レールシステム

メカニカルシヤット

アキュセリ

レーザ&プロジェクト

ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット

フィルタマウント

実験キット
プロジェクト